

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】令和3年3月25日(2021.3.25)

【公開番号】特開2019-145328(P2019-145328A)

【公開日】令和1年8月29日(2019.8.29)

【年通号数】公開・登録公報2019-035

【出願番号】特願2018-28166(P2018-28166)

【国際特許分類】

H 01 J	37/30	(2006.01)
H 01 J	37/28	(2006.01)
H 01 J	37/317	(2006.01)
H 01 J	37/147	(2006.01)
G 01 N	23/2251	(2018.01)
H 01 L	21/66	(2006.01)

【F I】

H 01 J	37/30	Z
H 01 J	37/28	B
H 01 J	37/317	D
H 01 J	37/147	D
G 01 N	23/2251	
H 01 L	21/66	J
H 01 L	21/66	N

【手続補正書】

【提出日】令和3年2月5日(2021.2.5)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0043

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0043】

再び図3を参照して、偏向電極(偏向手段)46は、互いに対向して配された1組以上の平行平板電極から構成されている。この平行平板電極からなる偏向電極46は、電子ビーム鏡筒15からの漏れ磁場によってアルゴンイオンビーム(GB)が偏向する偏向方向(図3中の実線矢印D2を参照)と逆の方向にアルゴンイオンビーム(GB)を偏向させる。

これによって、外部磁場によるアルゴンイオンビーム(GB)の偏向量と同一の偏向量となる磁場を発生させる電圧を偏向電極(偏向手段)46に印加することで、アルゴンイオンビーム(GB)を用いた試料Sの加工時に視野補正を行うことができる。